物理学报 Acta Physica Sinica



利用石墨烯等离激元与表面声子耦合增强量子摩擦

张超杰 周婷 杜鑫鹏 王同标 刘念华

Enhancement of quantum friction via coupling of surface phonon polariton and graphene plasmons

Zhang Chao-Jie Zhou Ting Du Xin-Peng Wang Tong-Biao Liu Nian-Hua

引用信息 Citation: Acta Physica Sinica, 65, 236801 (2016) DOI: 10.7498/aps.65.236801 在线阅读 View online: http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.236801 当期内容 View table of contents: http://wulixb.iphy.ac.cn/CN/Y2016/V65/I23

您可能感兴趣的其他文章 Articles you may be interested in

摩擦导致的聚合物表层微观结构改变

Microstructure changes of amorphous polymer film induced by friction 物理学报.2015, 64(6): 066801 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.066801

纳米级随机粗糙表面微观滑动摩擦力的计算研究

Study on micro sliding friction of randomly nanorough surface 物理学报.2013, 62(10): 106801 http://dx.doi.org/10.7498/aps.62.106801

石墨烯层间纳米摩擦性质的第一性原理研究

First-principles study of nanoscale friction between graphenes 物理学报.2012, 61(10): 106801 http://dx.doi.org/10.7498/aps.61.106801

基于石墨烯涂覆空心光纤电光调制特性的研究

Study on the electro-optic modulation properties of graphene-coated hollow optical fiber 物理学报.2016, 65(4): 047801 http://dx.doi.org/10.7498/aps.65.047801

全新的电导率特征矩阵方法及其在石墨烯 THz 频率光学特性上的应用

A new characteristics matrix method based on conductivity and its application in the optical properties of graphene in THz frequency range

物理学报.2015, 64(5): 057801 http://dx.doi.org/10.7498/aps.64.057801

利用石墨烯等离激元与表面声子耦合 增强量子摩擦*

张超杰¹) 周婷¹) 杜鑫鹏¹) 王同标¹, 刘念华²)

1) (南昌大学物理系, 南昌 330031)

2) (南昌大学高等研究院,南昌 330031)

(2016年3月7日收到; 2016年8月30日收到修改稿)

详细研究了以SiC为基底的石墨烯之间量子摩擦.由于SiC可以支持表面声子极化子,石墨烯可以支持 表面等离激元,在一定的频率范围,表面声子极化子和等离激元能够耦合.发现相对于单纯石墨烯或SiC来 说,由于表面声子极化子与石墨烯等离激元的共同作用,以SiC为基底的石墨烯之间的量子摩擦有很大的增 强.此外,我们发现量子摩擦系数随石墨烯化学势的增加先增加后减小,摩擦系数可以取得最大值.本文的研 究对于微/纳机电系统的制作具有积极的意义.

关键词:量子摩擦,石墨烯,等离激元 PACS: 68.35.Af, 78.67.Wj, 73.20.Mf

DOI: 10.7498/aps.65.236801

1引言

摩擦是自然界中普通存在的一种现象,摩擦力 在各种尺度范围内都广泛存在.在宏观尺度下,摩 擦力存在于相互接触的两物体之间,然而在纳米尺 度下,即便是在没有直接接触时,由于量子效应,两 物体作相对运动时也会有摩擦力,这种摩擦力称为 非接触摩擦力^[1-6].已有许多实验测量到非接触 摩擦力的存在^[2,3,5],然而关于非接触摩擦力的物 理起源也不尽相同.镀金探针与金表面之间的非 接触摩擦力来自于金表面涨落电场与探针表面电 荷的相互作用^[2];探针与高分子薄膜之间的非接触 摩擦力来自于薄膜内电介质的涨落^[3],它会在针尖 处产生随时间变化的电场;当Pt-Ir(铂-铱)针尖在 NbSe2或SrTiO3样品表面附近滑动时,来自于样 品表面的缺陷与针尖能够产生自旋-自旋耦合^[5,6], 它们之间的自旋弛豫动力学产生的反作用项可以 改变非接触摩擦系数.除上述几种机理外,还有一种是当两物体在纳米尺度距离下作相对运动时,由于物体周围总是存在电磁场(或者在有限温度下,物体本身也会向外界辐射电磁波),并且电磁场会在两物体表面产生反射,作相对运动的物体之间能够交换多普勒频移光子,这种由于光子动量交换产生的非接触摩擦,称为量子摩擦^[7].

根据量子理论, 在绝对零度时真空中依然存在 电磁涨落. 1997年, Pendry^[7]首次从理论上计算了 两块无限大的分开很小距离的两块介质板之间的 摩擦力, 发现由于真空中电磁涨落的存在, 即使在 绝对零度时量子摩擦依然存在. Volokitin和 Persson^[8–14]在量子摩擦方面也做了一系列的研究工 作. 2003年, 他们研究了两块金属导体之间的量子 摩擦问题^[10], 从理论上发现, 当金属表面有一些吸 附物, 从而可以引起共振光子隧穿, 或者能够支持 低频表面等离激元时, 完美金属之间的量子摩擦 可以增加几个数量级^[10]. 尽管量子摩擦是否能够

* 国家自然科学基金(批准号: 11264029, 11264030)和江西省自然科学基金(批准号: 20151BAB202017)资助的课题.

© 2016 中国物理学会 Chinese Physical Society

[†]通信作者. E-mail: tbwang@ncu.edu.cn

在绝对零度时存在也曾引起了一些争议^[15-20],但 量子摩擦的理论研究成果已经被人们普遍接受^[21]. 除了作相对平动的物体之间的量子摩擦以外,人们 也研究了转动的粒子在介质平面附近的转动量子 摩擦问题^[22-25].此外,文献[26]还利用统计力学 的方法计算了单个原子以恒定的速度在介质平面 附近运动时的量子摩擦.

石墨烯是一种由碳原子组成的二维材 料^[27-29],它具有十分优异的电子学、力学和光 学性质,在最近十多年被广泛研究^[30-36].尤其是 当石墨烯掺杂后,或者在外加电场下,石墨烯也可 以支持表面等离激元[37-39],并且相对于金属等离 激元来说,石墨烯等离激元有更多的优点,比如可 以支持p偏振和s偏振两种偏振模式^[37],而且在石 墨烯中的损耗相对于金属来说要小得多. 更为重 要的一点是,石墨烯的电导率可以通过调节其化学 势来进行调节,从而调节其光学性质.正是由于石 墨烯等离激元的强局域性和易于调节的特点,我 们选择石墨烯作为研究量子摩擦的材料. 文献 [40] 研究了以普通介电材料为基底的石墨烯之间的量 子摩擦,详细讨论了石墨烯的化学势、温度、介质 的介电常数以及石墨烯之间的距离对量子摩擦的 影响.

通常来说,量子摩擦力很小,并且由于诸多因 素的影响,在实验上测量这种力非常困难,提高材 料之间的量子摩擦力对于实验上测量这种微小的 力具有一定的帮助. 我们知道一些表面模式对于增 强量子摩擦具有显著作用^[10], 然而, 不同类型的表 面模式之间的耦合对量子摩擦的影响还不清楚.本 文我们研究以SiC为基底的石墨烯之间的量子摩 擦,由于SiC能够支持表面声子极化子,而石墨烯 可以支持表面等离激元,这两种模式在一定的频率 范围可以耦合,并且它们的耦合也可以通过石墨烯 的化学势进行调节. 石墨烯所支持的表面等离激元 主要局域在石墨烯的表面附近,在垂直于石墨烯表 面的方向是衰减的. 相对于单独的石墨烯来说, 表 面等离激元在石墨烯-介质结构中衰减得更快,具 有更短的衰减长度.因此,SiC的存在使得表面等 离激元在空间上有更小的局域范围,能够在更小的 范围内展现更强的局域强度. 我们发现由于表面 等离激元与表面声子极化子的耦合,以SiC为基底 的石墨烯之间的量子摩擦相对于单纯石墨烯或SiC 来说都有很大的增强.

2 理论模型

本文研究的模型如图 1 所示,两片单层石墨烯 分别附着在 SiC 基底上,其中一片与 SiC 一起相对 于另一片沿 x 轴方向平动,平动速度大小为v.两石 墨烯之间距离为D,周围环境的温度为室温T.当 速度大小v满足 $v < Dk_{\rm B}T/\hbar$,两石墨烯之间的量 子摩擦力近似为 $f = \gamma v^{[13]}$,其中 $k_{\rm B}$ 是 Boltzmann 常数, \hbar 是 Planck 常数. $\gamma = \gamma^{\rm rad} + \gamma^{\rm evan}$ 为量子摩 擦系数,它来自两部分的贡献,即石墨烯表面的传 播模式和倏逝模式,来自传播模式贡献的摩擦系数 可以写为^[13]

$$\gamma^{\rm rad} = \frac{\hbar}{8\pi} \int_0^\infty \mathrm{d}\omega \left(-\frac{\partial n}{\partial\omega}\right) \int_0^{\omega/c} \mathrm{d}q q^3$$
$$\times \frac{(1 - |R_{1\rm p}|^2)(1 - |R_{2\rm p}|^2)}{|1 - \mathrm{e}^{ikD} R_{1\rm p} R_{2\rm p}|^2} + [\mathrm{p} \to \mathrm{s}], \ (1)$$

来自倏逝模式贡献的摩擦系数可以写为[13]

$$\gamma^{\text{evan}} = \frac{\hbar}{2\pi^2} \int_0^\infty d\omega \left(-\frac{\partial n}{\partial \omega} \right) \int_{\omega/c}^\infty dq q^3 \\ \times e^{-2|k|D} \frac{\text{Im}(R_{1\text{p}})\text{Im}(R_{2\text{p}})}{|1 - e^{-2|k|D}R_{1\text{p}}R_{2\text{p}}|^2} \\ + [\text{p} \to \text{s}], \qquad (2)$$

其中 $n(\omega) = \frac{1}{\exp[\hbar\omega/(k_{\rm B}T)] - 1}$. q为平行于石墨 烯平面的波矢分量, $k = [(\omega/c)^2 - q^2]$, R_{ip} (i = 1, 2) 是 p 偏振下石墨烯表面的反射系数. [$p \rightarrow s$] 指将 表达式中的第一项里面的 p 偏振用 s 偏振代替. (1) 和(2) 式中对平行波矢分量 q 的积分式与石墨烯两 表面的反射系数有关,称为谱转移函数 (spectral transfer function, STF), 记为下面的表达式:



图 1 以SiC为基底的石墨烯之间的量子摩擦示意图 Fig. 1. Schematic diagram of the quantum friction between two graphene sheets with SiC substrates.

$$f_{\rm p}^{\rm rad} = -\frac{\partial n}{\partial \omega} \int_0^{\omega/c} \mathrm{d}q q^3 \frac{(1-|R_{\rm 1p}|^2)(1-|R_{\rm 2p}|^2)}{|1-\mathrm{e}^{\mathrm{i}kD}R_{\rm 1p}R_{\rm 2p}|^2},$$
(3)

$$f_{\rm p}^{\rm evan} = -\frac{\partial n}{\partial \omega} \int_{\omega/c}^{\infty} \mathrm{d}q q^3 \,\mathrm{e}^{-2|k|D} \\ \times \frac{\mathrm{Im}(R_{1\mathrm{p}})\mathrm{Im}(R_{2\mathrm{p}})}{|1 - \mathrm{e}^{-2|k|D}R_{1\mathrm{p}}R_{2\mathrm{p}}|^2}.$$
 (4)

用 ε_s 表示基底SiC的介电函数,它可以由Lorentz 模型 $\varepsilon_s(\omega) = \varepsilon_{\infty}(\omega^2 - \omega_L^2 + i\Gamma\omega)/(\omega^2 - \omega_T^2 + i\Gamma\omega)$ 给出,其中 $\varepsilon_{\infty} = 6.7$, $\omega_L = 1.827 \times 10^{14} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $\omega_T = 1.495 \times 10^{14} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$, $\Gamma = 0.9 \times 10^{12} \text{ rad} \cdot \text{s}^{-1}$. 根据Fresnel公式,石墨烯表面s偏振和p偏振的反 射系数分别用下面的公式表示^[34,35]:

$$R_{\rm s} = \frac{k_0 - k_m - \mu_0 c\sigma}{k_0 + k_m + \mu_0 c\sigma},\tag{5}$$

$$R_{\rm p} = \frac{k_0 \varepsilon_{\rm s} - k_m + \mu_0 c\sigma k_0 k_m}{k_0 \varepsilon_{\rm s} + k_m + \mu_0 c\sigma k_0 k_m},\tag{6}$$

 $\label{eq:k0} \begin{subarray}{lll} \begin$

σ(ω)称为石墨烯的电导率,它分别由带内跃迁和带 间跃迁两部分组成^[34,35]:

$$\sigma_{\rm D} = \frac{\mathrm{i}}{\omega + \mathrm{i}\tau^{-1}} \frac{2\,\mathrm{e}^2 k_{\rm B}T}{\pi\hbar^2} \ln\left[2\cosh\left(\frac{\mu}{2k_{\rm B}T}\right)\right],\tag{7}$$

$$\sigma_{\rm I} = \frac{{\rm e}^2}{4\hbar} \bigg[G(\hbar\omega/2) + {\rm i}\frac{4\hbar\omega}{\pi} \int_0^\infty \frac{G(x) - G(\hbar\omega/2)}{(\hbar\omega)^2 - 4x^2} {\rm d}x \bigg].$$
(8)

$$G(x) = \frac{\operatorname{Sim}(x/(k_{\rm B}T))}{\left[\cosh(\mu/(k_{\rm B}T)) + \cosh(x/(k_{\rm B}T))\right]}$$

μ 是石墨烯的化学势,它可以由载流子的浓度 $n_0 = (\mu/\hbar v_F)^2/\pi$ 决定, v_F 为费米速率,载流子的 浓度 n_0 可以通过栅极电压控制. τ 是弛豫时间, 主要是由电子杂质、电子缺陷以及声子对电子的 散射造成的, τ 可以由电子迁移率和化学势决定, $\tau = \mu_{dc}\mu/(ev_F^2), \mu_{dc}$ 为电子迁移率.



图 2 (网刊彩色) (a) 和 (b) 分别为石墨烯表面反射系数的实部和虚部, 化学势 $\mu = 0.2$ eV; (c) 和 (d) 分别为 SiC-石 墨烯表面反射系数的实部和虚部, 化学势 $\mu = 0.2$ eV

Fig. 2. (color online) Real (a) and imaginary (b) parts of reflection coefficient from suspended graphene sheet; Real (c) and imaginary (d) parts of reflection coefficient from graphene sheet with SiC substrate. The chemical potential of graphene is set to be $\mu = 0.2$ eV.

236801-3

3 结果与讨论

尽管石墨烯也可以支持s偏振模式等离激元, 但由于在近场范围内s偏振模式的贡献相对于p偏 振模式来说可以忽略,所以在下面的研究中我们 只考虑p偏振模式等离激元的贡献.由表达式(1) 和(2)式可知,量子摩擦系数与反射系数有关,在



图 3 (网刊彩色) 谱转移函数的被积函数 (a) 单纯石墨烯, $\mu_1 = 0.18$ eV, $\mu_2 = 0.2$ eV; (b) 单纯石墨烯, $\mu_1 = 0.2$ eV, $\mu_2 = 0.2$ eV; (c) SiC 材料; (d) 以普通介质为基底的石墨烯, $\varepsilon = 4.0$, $\mu_1 = 0.2$ eV, $\mu_2 = 0.2$ eV; (e) 以 SiC 为基底的石墨烯, $\mu_1 = 0.18$ eV, $\mu_2 = 0.2$ eV; (f) 以 SiC 为基底的石墨烯, $\mu_1 = 0.2$ eV, $\mu_2 = 0.2$ eV; Fig. 3. (color online) Contour plot of the integrand in f_p^{evan} from Eq. (4): (a) Suspended graphene sheets with chemical potentials of $\mu_1 = 0.18$ eV and $\mu_2 = 0.2$ eV; (b) suspended graphene sheets with chemical potentials of $\mu_1 = 0.2$ eV; (c) bulk SiC materials; (d) graphene sheets with dielectric substrates, the permittivities of dielectrics are $\varepsilon = 4.0$, the chemical potentials are $\mu_1 = 0.2$ eV and $\mu_2 = 0.2$ eV; (e) graphene sheets with SiC substrates, the chemical potentials are $\mu_1 = 0.18$ eV and $\mu_2 = 0.2$ eV; (f) graphene sheets with SiC substrates, the chemical potentials are $\mu_1 = 0.18$ eV and $\mu_2 = 0.2$ eV; (f) graphene sheets with SiC substrates, the chemical potentials are $\mu_1 = 0.2$ eV and $\mu_2 = 0.2$ eV; (f) graphene sheets with SiC substrates, the chemical potentials are $\mu_1 = 0.2$ eV and $\mu_2 = 0.2$ eV; (f) graphene sheets with SiC substrates, the chemical potentials are $\mu_1 = 0.2$ eV and $\mu_2 = 0.2$ eV; (f) graphene sheets with SiC substrates, the chemical potentials are $\mu_1 = 0.2$ eV and $\mu_2 = 0.2$ eV; (f) graphene sheets with SiC substrates, the chemical potentials are $\mu_1 = 0.2$ eV and $\mu_2 = 0.2$ eV; (f) graphene sheets with SiC substrates, the chemical potentials are $\mu_1 = 0.2$ eV and $\mu_2 = 0.2$ eV; (f) graphene sheets with SiC substrates, the chemical potentials are $\mu_1 = 0.2$ eV and $\mu_2 = 0.2$ eV; (f) graphene sheets with SiC substrates, the chemical potentials are $\mu_1 = 0.2$ eV and $\mu_2 = 0.2$ eV.

图 2 中给出了 p 偏振模式下石墨烯表面等离激元的 反射系数的实部和虚部.从反射系数上可以看出, 对于石墨烯来说,只有表面等离激元模式(图 2 (a) 和图 2 (b)); 而对于 SiC-石墨烯结构来说,表面声子 极化子模式和表面等离激元模式同时存在(图 2 (c) 和图 2 (d)),关于这些表面模式对量子摩擦的贡献 我们将在下面详细进行讨论. 图 3 中我们给出了 p 偏振下谱转移函数 (4) 式的被积函数, 被积函数与上下两层石墨烯的反射系数都有关系, 能够反映来自上下两表面表面模式的耦合情况. 对于单纯石墨烯来说, 当两石墨烯的化学势相差不大时, 例如: $\mu_1 = 0.18 \text{ eV}, \mu_2 = 0.2 \text{ eV},$ 在谱转移函数的被积函数中有两条非常亮的区域,由于它们的圆频率小于 300 THz, 如图 3 (a) 所示,对应的能量值小于所取的石墨烯的化学势, 这是来自石墨烯电子带内跃迁的贡献, 因此可以判断为等离激元模式.并且两石墨烯之间等离激元模式有一定的耦合, 但此时耦合比较弱. 当两石墨烯的化学势相同时, $\mu_1 = 0.2 \text{ eV}, \mu_2 = 0.2 \text{ eV},$ 等离激元模式之间的耦合变得很强, 如图 3 (b) 所示.

图3(c)和图3(d)对应的分别是SiC材料和以 普通介质材料为基底的石墨烯的STF的被积函数, 普通介质的介电常数任取为ε = 4.0. 对于SiC来 说,可以看到在其共振频率149.5 THz附近,谱转 移函数的被积函数有一个很强的声子模式存在 (图3(c)),这个声子模式是由SiC材料的共振频率 决定的,它不随频率变化.而对于介质-石墨烯结构 来说,尽管图3(d)中石墨烯的化学势与图3(b)中 完全相同,但是相对单纯石墨烯(图3(b))来说,介 质的存在使等离激元模式向低频方向移动.因此, 可以判断当有SiC存在时,石墨烯的等离激元模式 也会出现在与图3(b)不同的位置.



图 4 三种不同材料的谱转移函数,三种情况下的谱转移 函数值都以 SiC 的 STF 的最大值进行了归一化

Fig. 4. Spectral transfer function (STF) $f_{\rm p}^{\rm evan}$ from Eq. (4) for three different samples. The values of STF for all samples are normalized with the maximum STF for SiC.

对于石墨烯-SiC结构来说,由于SiC可以支 持表面声子极化子,石墨烯可以支持表面等离激 元,来自于SiC的声子模式可以与来自于石墨烯 的等离激元模式耦合.这种耦合并不是两种模式 简单的叠加,它们会相互影响,如图3(e)和图3(f) 所示,由于SiC的影响,等离激元模式在更低频率 范围出现,这与图3(d)的结果是类似的.表面声 子模式的位置发生了一些变化,不再是与频率无 关的,这表明石墨烯等离激元模式对声子模式产 生了影响.当两石墨烯的化学势取 $\mu_1 = 0.18 \text{ eV},$ $\mu_2 = 0.2 \text{ eV}$ 时,声子模式和等离激元模式的耦合 都不是太强,从图3(e)中可以清楚看到,两声子模 式并没有完全重合在一起.当两石墨烯的化学势取 $\mu_1 = \mu_2 = 0.2 \text{ eV}$ 时,不仅等离激元模式耦合变强, 声子模式的耦合也变得很强,如图3(f)所示,两声 子模式和两等离激元模式都分别重合在一起.



图 5 三种材料之间的量子摩擦系数与距离的关系, 所用 的参数与图 4 中的相同

Fig. 5. Quantum friction coefficients as a function of distance for three different samples. All the parameters are the same with that in Fig. 4.

在图4中我们给出SiC(虚线)、石墨烯(点线) 以及SiC-石墨烯(实线)的谱转移函数. 在这里我们 取石墨烯的化学势为 $\mu_1 = \mu_2 = 0.2$ eV, 石墨烯之 间的距离D = 10 nm, 环境温度取为300 K. 由(2) 式可以看出,量子摩擦系数是对谱转移函数的积 分,所以图4中谱转移函数曲线下面所包围的面积 就是量子摩擦系数. 从图4可以明显地看出, 对于 SiC来说, STF有一个很强的峰, 对应的是SiC材料 表面声子的共振频率,所以SiC中对量子摩擦的主 要贡献来自于表面声子极化子. 而单独石墨烯的 STF 谱很宽, 这正是因为由电子带内跃迁决定的等 离激元有很宽的频率造成的,所以单独石墨烯之间 的量子摩擦主要来自于表面等离激元. 对于 SiC-石 墨烯来说,量子摩擦主要来自于表面声子极化子和 表面等离激元的共同贡献.对于SiC-石墨烯来说, 谱转移函数中有两个比较强的宽频峰出现,分别来 自于石墨烯等离激元和表面声子极化子的贡献.与 单独石墨烯相比,来自于等离激元贡献的频率范围 变窄了,这主要是由于SiC的存在将石墨烯中由于 带内电子跃迁产生的宽谱等离激元的频率范围变 窄了,但是却使局域强度增强.由于石墨烯等离激 元与表面声子极化子之间存在耦合,它们可以相互 影响,当石墨烯的化学势改变时,表面声子极化子 也会受到影响.由STF也可简单看到SiC-石墨烯 (实线)所包围的面积比SiC和单独石墨烯所包围的 面积都要大,这就表明SiC-石墨烯结构能够增强量 子摩擦.

由图4可以定性分析影响量子摩擦的因素,但 要定量得到量子摩擦系数与距离之间的关系惟 有利用(2)式.我们在图5中给出了三种材料之间 的量子摩擦系数与距离的关系,计算中的参数与 图4中所选用的参数相同.由图5可以看出,三种 情况下摩擦系数都会随距离的增加而降低,但SiC-石墨烯结构的量子摩擦系数随距离增加比单独石 墨烯下降得要缓慢.SiC-石墨烯之间的摩擦系数要 比单独SiC和单独石墨烯的要大,这表明表面声子 极化子与等离激元的耦合可以很大地提高量子摩 擦系数,这与我们前面根据谱转移函数的分析是一 致的.

接下来我们研究石墨烯化学势的变化对量子 摩擦的影响.在图6中,我们给出石墨烯化学势取 不同值时的谱转移函数,虚线、点线和实线所对应 的石墨烯的化学势为0.1,0.2和0.3 eV.我们发现 随着化学势的增加,谱转移函数中的等离激元模式 会向高频方向移动,并且峰值随化学势的增加会降 低.由于表面声子与石墨烯等离激元的耦合,表面 声子模式也会受到石墨烯化学势变化的影响.当 石墨烯的化学势增大时,表面声子模式也会向高 频方向移动,表面声子模式的峰值会迅速降低,并 且会得到展宽.当化学势为0.1 eV时,表面声子模 式的峰值比SiC本征峰值还要大,而当化学势变为 0.3 eV时,表面声子模式的贡献被很大地削弱了.

图 7 给出石墨烯化学势取不同值时, SiC-石墨 烯之间量子摩擦系数与距离的关系, 在计算中所采 用的参数值与图 6 中完全相同. 可以看出随着距离 的增加, 三种情况的摩擦系数都会降低. 当化学势 由 0.2 eV不连续变化到 0.3 eV 时, 在我们所研究的 距离范围, 量子摩擦系数是降低的. 然而, 当化学 势由 0.1 eV 变化到 0.2 eV 时, 两石墨烯的距离大于 15 nm时,量子摩擦系数会随化学势的增加而增加; 而当距离小于15 nm时,量子摩擦系数随化学势增 加而降低.由此看出,量子摩擦系数同时与距离和 化学势有关,所以我们需要进一步分析摩擦系数与 化学势的关系.



图 6 石墨烯化学势取不同值时的谱转移函数,三种情况下的 谱转移函数值都以 SiC 的 STF 的最大值进行了归一化

Fig. 6. Spectral transfer function $f_{\rm p}^{\rm evan}$ from Eq. (4) for three different chemical potentials. The values of STF for all samples are normalized with the maximum STF for SiC.



图 7 石墨烯化学势取不同值时, SiC-石墨烯之间的量子 摩擦系数与距离的关系

Fig. 7. Quantum friction coefficients between graphene sheets with SiC substrates as a function of distance for different chemical potentials.

图 8 中我们给出量子摩擦系数随石墨烯化学 势的变化关系,图中虚线、点线和实线对应的石墨 烯之间的距离分别为10,20和30 nm.可以看出对 于我们所任给的三种距离,它们的摩擦系数都会随 着化学势的增加先增加,到达最大值后随着化学势 的增加而减小,摩擦系数都可以取得最大值,并且 最大摩擦系数随距离的增加向化学势增大的方向 移动.由于表面声子和等离激元都会受到石墨烯化 学势的影响,当石墨烯化学势比较小时,表面声子 模式的贡献随化学势增加而增强;同时表面等离激 元主要分布在低频范围,随着化学势的增加,等离 激元的贡献会逐渐增加,此时,量子摩擦会随化学 势的增加而增大.当化学势继续增加时,表面声子 的贡献会被削弱(如图6所示),而石墨烯中部分电 子产生带间跃迁,这样也会削弱等离激元的作用, 摩擦系数会随着化学势的增加而缓慢减小.



图 8 不同距离下量子摩擦系数与石墨烯化学势之间的关 系

Fig. 8. The relationship between quantum friction coefficients and chemical potential for different distances.

4 结 论

本文研究了以SiC为基底的石墨烯之间的量 子摩擦,由于石墨烯可以支持表面等离激元,SiC 能够支持表面声子极化子,并且这两种表面模式在 一定的频率范围可以耦合.由于两种表面模式的耦 合,以SiC为基底的石墨烯之间的量子摩擦,相对 于单纯的石墨烯或者SiC来说有很大的增强.并且 研究了石墨烯的化学势对SiC-石墨烯结构之间的 量子摩擦的影响,发现随着化学势的增加,摩擦系 数先增加后降低,摩擦系数可以取得最大值.本文 的研究结果对于理解不同类型非接触摩擦的物理 机理具有重要帮助,对于超灵敏力的实验探测具有 潜在的应用价值,对于微/纳机电系统的制作也具 有一定的指导意义.

参考文献

- Dorofeyev I, Fuchs H, Wenning G, Gotsmann B 1999 Phys. Rev. Lett. 83 2402
- [2] Stipe B C, Mamin H J, Stowe T D, Kenny T W, Rugar D 2001 Phys. Rev. Lett. 87 096801
- [3] Kuehn S, Loring R F, Marohn J A 2006 *Phys. Rev. Lett.* 96 156103

- [4] Buchanan M 2007 Nat. Phys. 3 827
- [5] Saitoh K, Hayashi K, Shibayama Y, Shirahama K 2010 *Phys. Rev. Lett.* **105** 236103
- [6] She J H, Balatsky A V 2012 Phys. Rev. Lett. 108 136101
- [7] Pendry J B 1997 J. Phys. Condens. Matter 9 10301
- [8] Volokitin A I, Persson B N J 2001 J. Phys. Condens. Matter 13 859
- [9] Volokitin A I, Persson B N J 2002 Phys. Rev. B 65 115419
- [10] Volokitin A I, Persson B N J 2003 Phys. Rev. Lett. 91 106101
- [11] Volokitin A I, Persson B N J 2002 Phys. Rev. B 65 115420
- [12] Volokitin A I, Persson B N J 2005 Phys. Rev. Lett. 94 086104
- [13] Volokitin A I, Persson B N J 2007 Rev. Mod. Phys. 79 1291
- [14] Volokitin A I, Persson B N J 2011 Phys. Rev. Lett. 106 094502
- [15] Philbin T G, Leonhardt U 2009 New J. Phys. 11 033035
- [16] Pendry J B 2010 New J. Phys. 12 033028
- [17] Leonhardt U 2010 New J. Phys. 12 068001
- [18] Pendry J B 2010 New J. Phys. **12** 068002
- [19] Volokitin A I, Persson B N J 2011 New J. Phys. 13 068001
- [20] Philbin T G, Leonhardt U 2011 New J. Phys. 13 068002
- [21] Silveririnha M G 2014 New J. Phys. 16 063011
- [22] Manjavacas A, García de Abajo F J 2010 Phys. Rev. Lett. 105 113601
- [23] Manjavacas A, García de Abajo F J 2010 *Phys. Rev. A* 82 063827
- [24] Zhao R, Manjavacas A, García de Abajo F J, Pendry J
 B 2012 Phys. Rev. Lett. 109 123604
- [25] Bercegol H, Lehoucq R 2015 Phys. Rev. Lett. 115 090402
- [26] Intravaia F, Behunin R O, Dalvit D A R 2014 *Phys. Rev.* A 89 050101
- [27] Novoselov K S, Geim A K, Morozov S V, Jiang D, Zhang Y, Dubonos S V, Grigorieva I V, Firsov A A 2004 Science 306 666
- [28] Novoselov K S, Jiang D, Schedin F, Booth T J, Khotkevich V V, Morozov S V, Geim A K 2005 Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 102 10451
- [29] Novoselov K S, Geim A K, Morozov S V, Jiang D, Katsnelson M I, Grigorieva I V, Dubonos S V, Firsov A A 2005 Nature 438 197
- [30] Zhang Y, Tan Y W, Stormer H L, Kim P 2005 Nature 438 201
- [31] Geim A K, Novoselov K S 2007 Nat. Mater. 6 183
- [32] Berger C, Song Z, Li X, Wu X, Brown N, Naud C, Mayou D, Li T, Hass J, Marchenkov A N, Conrad E H, First P N, de Heer W A 2006 *Science* **312** 1191
- [33] Freitag M, Low T, Xia F, Avouris P 2013 Nat. Photonics 7 53
- [34] Stauber T, Peres N M R, Geim A K 2008 *Phys. Rev. B* 78 085432
- [35] Falkovsky L A 2008 J. Phys. Conf. Ser. 129 012004

- [36] Falkovsky L A, Pershoguba S S 2007 Phys. Rev. B 76 153410
- [37] Mikhailov S A, Ziegler K 2007 Phys. Rev. Lett. 99 016803
- [38] Ju L, Geng B, Horng J, Girit C, Martin M, Hao Z, Bechtel H A, Liang X, Zettl A, Shen Y R, Wang F 2011 Nat.

Nanotechnol. 6 630

- [39] Jablan M, Buljan H, Soljačić M 2009 Phys. Rev. B 80 245435
- [40] Wang T B, Liu N H, Liu J T, Yu T B 2014 Eur. Phys. J. B 87 185

Enhancement of quantum friction via coupling of surface phonon polariton and graphene plasmons^{*}

Zhang Chao-Jie¹⁾ Zhou Ting¹⁾ Du Xin-Peng¹⁾ Wang Tong-Biao^{1)†} Liu Nian-Hua²⁾

1) (Department of Physics, Nanchang University, Nanchang 330031, China)

2) (Institute for Advanced Study, Nanchang University, Nanchang 330031, China)

(Received 7 March 2016; revised manuscript received 30 August 2016)

Abstract

In our daily life, frictions are very common when two bodies in direct contact relatively move. However, when two bodies are separated by a finite distance, due to the quantum fluctuations inside the bodies, they may still experience a friction when they relatively move. Such a phenomenon is often called quantum friction, which has been studied for more than a decade. It has shown in previous studies that the surface modes, such as surface phonon polaritions (SPhPs) or surface plasmon polaritions (SPPs) have significant contribution to enhancing the quantum friction. However, to the best of our knowledge, the contribution of coupling from SPhPs and SPPs to quantum friction is still unknown. Here, we report a detailed study on the quantum frictions between two graphene sheets with the silicon carbide (SiC) substrates. For comparison, the quantum frictions between two other samples, i.e., SiC/SiC and graphene/graphene are also studied. As indicated in previous studies, SPhPs and SPPs, supported by SiC and graphene, respectively, can couple together in special frequency ranges. The coupling of SPhPs and SPPs can be tuned by varying the chemical potential of graphene. The coupling modes shift toward higher frequency as the chemical potential increases. Firstly, we analyze qualitatively the effects of coupled surface modes on quantum friction with the help of dispersion relation. Secondly, we calculate the quantum friction coefficients numerically for the three different samples. We find that due to the coupling of SPhPs and SPPs, the quantum friction between graphene sheets with SiC substrates is larger than that between the SiC or monolayer graphene sheets. We demonstrate that the coupling of SPhPs and SPPs can be modulated by chemical potential of graphene; therefore, the relationship between quantum friction coefficient and chemical potential is also studied. We observe that with the increase of chemical potential, quantum friction coefficient follows a nonmonotonic trend, i.e., it first increases to its maximum value then decreases. We believe that our studies are not only helpful in understanding the micro mechanisms of friction, but also meaningful in the fabrications of micro- and nano-electromechanical systems.

Keywords: quantum friction, graphene, plasmons PACS: 68.35.Af, 78.67.Wj, 73.20.Mf

DOI: 10.7498/aps.65.236801

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11264029, 11264030) and the Natural Science Foundation of Jiangxi Province, China (Grant No. 20151BAB202017).

[†] Corresponding author. E-mail: tbwang@ncu.edu.cn